特許協力条約

今後の手続きについては、様式PCT/1PEA/416を参照すること。

РСТ

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人



「					
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で3 ページからなる。					
3. この報告には次の附属物件も添付されている。					
a. 🔽 附属書類は全部で 3 ページである。					
▼ 補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範					
ã					
「 第 I 欄 4 . 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの 国際予備審査機関が認定した差替え用紙					
ı					
_					
Ī					
ı					

国際予備審査の請求書を受理した日 11.08.2005	国際予備審査報告を作成した日 05.10.2005	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 池渕 立	
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3471	

第1概	報告の基礎			
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。				
г	この報告は、 語による翻訳文を それは、次の目的で提出された翻訳文の言語であ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 PCT規則12.4にいう国際公開 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査	る 。		
2. この た差替え	D報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 上用紙は、この報告において「出願時」とし、この	: (PCT14条) の規定に基)報告に添付していない。)	づく命令に応答するために提出され	
۲	出願時の国際出願書類	•		
힉	明和書 第 <u>1-10</u> ページ、 第	出願時に提出されたも <i>の</i> 、 付	けで国際予備審査機関が受理したもの けけで国際予備審査機関が受理したもの	
হা	請求の範囲 第 3-8, 11-12 項、 第	出願時に提出されたもの 、PCT19条の規定に基づ 、11.08.2005	づき補正されたもの けけで国際予備審査機関が受理したもの	
r T	図面 第 1/5-5/5	出願時に提出されたもの 、 付 、 付	けけで国際予備審査機関が受理したもの けけで国際予備審査機関が受理したもの	
~ [·	•	
3. 1	▼ 請求の範囲 第 2,10			
4. F	この報告は、補充概に示したように、この報告にえてされたものと認められるので、その補正がさります。 「明細書 第	れなかったものとして作成 ペー 項 ペー	した。 (PC T規則 70.2(c)) -ジ	
* 4. 1	に該当する場合、その用紙に"superseded"と記入	、されることがある。	٠.	

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/015716

見解		
新規性(N)	請求の範囲 1,3-9,11-12	
	請求の範囲	<u></u>
進歩性(IS)	請求の範囲 1,3-9,11-12	
	請求の範囲	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1,3-9,11-12	
	請求の範囲	4 1

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献 1 JP 2000-144432 A (株式会社荏原製作所), 2000.05.26 文献 2 JP 57-37821 A (国際電気株式会社), 1982.03.02 文献 3 JP 3-122281 A (日電アネルバ株式会社), 1991.05.24

請求項1, 3-9, 11-12に記載された発明は、国際調査報告に引用された何れの引用文献にも記載されておらず、当業者にとっても自明のものとは認められない。

10/574531IAP15 Rec'd PCT/PTO 03 APR 2006

請求の範囲

[1] (補正後) 処理容器内で被処理体の表面に薄膜を堆積させるために、前記処理容器 内の真空雰囲気中へ原料ガスと支援ガスとを供給するシャワーヘッドにおいて、

前記処理容器内に面したガス噴射面を有するシャワーヘッド本体と、

前記シャワーヘッド本体内に形成され、前記原料ガスを受け入れて拡散させる第1の 拡散室と、

前記シャワーヘッド本体内に形成され、前記支援ガスを受け入れて拡散させる第2の 拡散室と、

前記第1の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の原料ガス噴射口と

前記第2の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の第1支援ガス噴射 ロと、

前記第2の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の第2支援ガス噴射口とを備え、

各第1支援ガス噴射口は、それぞれ前記原料ガス噴射口を近接して取り囲むリシグ状に形成され、

各第2支援ガス噴射口は、それぞれ隣り合う2つの前記原料ガス噴射口どうしの間に 配置されている、ことを特徴とするシャワーヘッド。

- [2] (削除)
- [3] 前記原料ガスは高融点金属を含有する、ことを特徴とする請求項1記載のシャワーへッド。
- [4] 前記原料ガスは有機金属材料ガスである、ことを特徴とする請求項3記載のシャワー ヘッド。
- [5] 処理容器内で被処理体の表面に薄膜を堆積させるために、前記処理容器内の真空 雰囲気中へ原料ガスと支援ガスとを供給するシャワーへッドにおいて、

前記処理容器内に面したガス噴射面を有するシャワーヘッド本体と、

前記シャワーヘッド本体内に形成され、前記原料ガスを受け入れて拡散させる第1の 拡散室と、

前記シャワーヘッド本体内に形成され、前記支援ガスを受け入れて拡散させる第2

の拡散室と、

前記第1の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の原料ガス噴射口と

前記第2の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の第1支援ガス噴射 口とを備え、

各原料ガス噴射口は、それぞれ複数の前記第1支援ガス噴射口によって近接して取り囲まれている、ことを特徴とするシャワーヘッド。

[6] 前記第2の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の第2支援ガス噴射 口を更に備え、

各第2支援ガス噴射口は、それぞれ隣り合う2つの前記原料ガス噴射口どうしの間に 配置されている、ことを特徴とする請求項5記載のシャワーヘッド。

- [7] 前記原料ガスは高融点金属を含有する、ことを特徴とする請求項5記載のシャワーへ ッド。
- [8] 前記原料ガスは有機金属材料ガスである、ことを特徴とする請求項7記載のシャワーヘッド。
- [9] (補正後)原料ガスと支援ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を堆積させる成膜装置において、

処理容器と、

前記処理容器内を真空排気する排気手段と、

前記処理容器内に設けられて前記被処理体を載置する載置台と、

前記載置台上の被処理体を加熱する加熱手段と、

前記処理容器の天井部に設けられたシャワーヘッドと、

を備え、

前記シャワーヘッドは、

前記処理容器内に面したガス噴射面を有するシャワーヘッド本体と、

前記シャワーヘッド本体内に形成され、前記原料ガスを受け入れて拡散させる第1の 拡散室と、

前記シャワーヘッド本体内に形成され、前記支援ガスを受け入れて拡散させる第2

の拡散室と、

前記第1の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の原料ガス噴射口と

前記第2の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の第1支援ガス噴射 ロと、

前記第2の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の第2支援ガス噴射口とを有し、

各第1支援ガス噴射口は、それぞれ前記原料ガス噴射口を近接して取り囲むリング状 に形成され、

各第2支援ガス噴射口は、それぞれ隣り合う2つの前記原料ガス噴射口どうしの間に 配置されている、ことを特徴とする成膜装置。

- [10] (削除)
- [11] 原料ガスと支援ガスとを用いて被処理体の表面に薄膜を堆積させる成膜装置において、

処理容器と、

前記処理容器内を真空排気する排気手段と、

前記処理容器内に設けられて前記被処理体を載置する載置台と、

前記載置台上の被処理体を加熱する加熱手段と、

前記処理容器の天井部に設けられたシャワーヘッドと、

を備え、

前記シャワーヘッドは、

前記処理容器内に面したガス噴射面を有するシャワーヘッド本体と、

前記シャワーヘッド本体内に形成され、前記原料ガスを受け入れて拡散させる第1の 拡散室と、

前記シャワーヘッド本体内に形成され、前記支援ガスを受け入れて拡散させる第2の 拡散室と、

前記第1の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の原料ガス噴射口と

前記第2の拡散室に連通して前記ガス噴射面に形成された複数の第1支援ガス噴